OPTICAL ELEMENT HAVING QUANTUM WELL STRUCTURE

Publication number: JP4174585

Publication date:

1992-06-22

Inventor:

TAKANO SHINJI

Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

- international:

G02F1/025; G02F1/017; G02F1/35; G02F1/355;

H01L21/20; H01L33/00; H01S5/00; G02F1/01;

G02F1/35; H01L21/02; H01L33/00; H01S5/00; (IPC1-7):

G02F1/025; G02F1/35; H01L21/20; H01L33/00;

H01S3/18

- European:

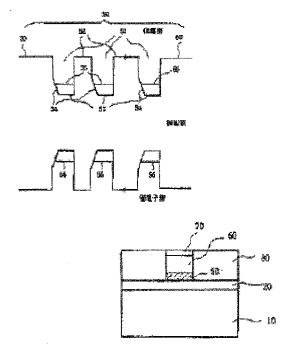
G02F1/017R; Y01N10/00

Application number: JP19900302232 19901107
Priority number(s): JP19900302232 19901107

Report a data error here

Abstract of JP4174585

PURPOSE: To increase the light emitting and absorbing efficiencies of the title element by using such a quantum well structure that the interface between a well and barrier layers is constituted of an inclined layer having a continuously varying forbidden band width. CONSTITUTION: A barrier layer 51 is made of InP and a well layer 52 is composed of an InGaAs layer 53 and inclined layer 54. The composition of the inclined layer 54 gradually changes from InGaAsP to InGaAs. After an n-InP clad layer 20, quantum well structure 50, p-InP clad layer 60, and p-InGaAsP contact layer 70 are formed on an n-InP semiconductor substrate 10, a multiplexed quantum well optical modulator having such structure is buried by means of high-resistance InP (Fe-doped) 80. By using such structure, an optical modulator which is low in driving voltage and has an excellent damping ratio is obtained. In other words, a high-performance element having a quantum well structure which is high in light emitting and absorbing efficiencies can be obtained.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

平4-174585 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成 4年(1992) 6月22日

3/18 1/025 H 01 S G 02 F 1/35 21/20 H 01 L

505

9170-4M 7159-2K 7246-2K 9171-4M 8934-4M

Α

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

量子并戸構造光素子 60発明の名称

33/00

②特 願 平2-302232

顧 平2(1990)11月7日 22出

@発 明 者 高 野

7 信

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

团出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

個代 理 人 弁理士 内原

発明の名称

量子并戸精造光索子

特許讚求の範囲

1. 半導体蒸板上に、量子井戸構造を含む半導 体薄膜を積層してなる量子弁戸構造光素子におい て、前記風子井戸構造の井戸層と障壁圏の界面の うち少なくとも一方の界面が、連続的に禁制格幅 の変化する傾斜層であることを特徴とする量子井 戸 撤 浩 光 繁 子 。

2、請求項1記載の量子井戸構造光素子におい て、前記界面の一部の禁制帯輻が連続的に変化す ることを特徴とする量子井戸構造光素子。

3. 請求項1記載の量子井戸精造光素子におい て、量子弁戸精造に印加される電界の正電位側の 界面の禁制帯幅が選続的に変化することを特徴と する量子井戸精造光素子。

発明の詳離な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は量子井戸構造光素子に関する。

〔従来の技術〕

近年、有機金属気相エピタキシー(MOVP E)技術、分子線エピタキシー (MBE)技術な どの薄膜結晶成長技術の急速な進展に伴い、単原 子層の厚さの精度で急峻な組成変化を持った良質 な半導体ヘテロ接合界面が製作されるようになっ た。これらのヘテロ接合によって形成されるボテ ンシャル并戸構造、超格子構造では電子の波動性 に起因する特異な光学特性、電気特性を有してお りデバイス応用への研究が活発化している。この ような電子の波動性の顕在化する現象の中で最も 代表的なものには量子サイズ効果とトンネル効果 がある。

例えばトンネル効果をデバイスに応用した例と しては、共鳴トンネルダイオード、ホットエレク トロントランジスタがある。

また、量子券再期を活性層とした最子券戸機造

半導体レーザは前述のような量子サイズ効果によって生じる高い状態密度をもつ量子準位簡のの接条のがブルヘテロ接触を利用したもので、従来のダブルヘテロ接流、(2) 温度安定性、(3) 高い発光効率、(4) 緩和では、(2) 温度安定性、(5) スペクトル線幅、チャとの制度数の増大、(5) スペクトル線幅、チャとが型とができる。これらの優れた特性は2次元で報面内に電子および正孔を局在させたために生じた量子力学的効果による。

さらに量子サイズ効果を光素子に応用した例として、電界吸収形の多重量子井戸光変調器がある。これは量子井戸港澄が二次元的なパンド構造を有するため急峻な吸収増をもち、またに窓温においても励起子が存在し電界効果がパルクに比比で大きいことを利用しようとするものである。量子井戸精造に垂直に105 V/cm程度収収ビークは電界強度の2乗に比例して長波長側にシフトする。このような量子閉じ込めシュタルク効果(Quantus

手段は、半導体基板上に、量子井戸構造を含む半 導体薄膜を積層してなる量子井戸構造光素子にお いて、井戸層と除態層の界面のうち少なくとも一 方の界面が、連続的に禁制帯幅の変化する傾斜層 である量子井戸構造を用いる。

すなわち、本発明では井戸層と障壁層の界面が 連続的に禁制帯幅の変化する傾斜層である量子井 戸構造を用い、波動閥数の空間的な分離を抑える ことによって選移確率を与える行列要素の減少を 抑制し、量子井戸構造光業子における発光および 吸取効率の増大を図っている。

(作用)

第3図は本発明の原理を説明する量子井戸橋造の電界印加時のエネルギー図である。電界印加時に波動関数 ψ c 、 ψ 、 は空間的に分離するが、本発明によれば、降壁層との界面では無削帯幅が連続的に変化しているため、電界印加による実効的なエネルギーギャップの減少に伴い、伝導帯の波動関数 ψ c は前途の空間的分離を打消す方向に移動する。

Confined Stark Effect)を応用した例としては、K.Wakita等が1987年にジャーナル・オブ・クウォンタム・エレクトロニクス誌QE-23巻2210-2215 頁(K.Wakita et al., IEEE J.Quantum Electron., QE-23、pp.2210-2215.1987)に報告した電界吸収形の多鑑量子井戸光変調器がある。
[発明が解決しようとする課題]

しかし、一般に量子共戸構造に電界が印加された場合では波動関数の対称性が失われ、第4図に示すように伝導帯の波動関数からは印数が限数がある。また、印加電界の波動関数がない。は負電位側に、循電子等の加電界の増加をとして実効的なエネルギーギャップは減少する。といって、波動関数がの、かいの空間的な分が難にるよって、波動関数がある。よる行列要素は減少する。よって経発の確率を与える行列要素は減少する。よって経発の確率を与える行列要素は減少する。よっては発光および吸収効率の低下が生じていた。

(譲題を解決するための手段)

前述の課題を解決するために本発明が提供する

この場合では、伝導帯のエネルギー不違統△ E。が個電子帯のエネルギー不違統△E。よりも 小さく、正電位側の繋制帯幅が連続的に変化する 儀斜層としているが、伝導帯のエネルギー不連続 の方が大きい場合等では負電位側の界面を傾斜層 とした方が有効となる場合がある。

〔実施例〕

本発明による第一の実施例を第1図を参照して 詳細に説明する。量子井戸構造の成長法としては 有機金属気相成長(MOVPE)法を用いた。

第1図(a)に本発明による量子井戸構造50のエネルギーバンド図を示す。障壁層51はInPであり、井戸層52はInGaAs層(厚き40A)53および傾斜層54から構成され、傾斜層54は厚き15Aでその組成は1.4μm組成InGaAsPからInGaAsまで連続的に変化している。55.56はそれぞれ井戸圏の伝導帯、価電子帯の基底量子準位であり、その禁制帯幅は0.85eV(波長換算で1.46μm)である。

第1図(b)は上記の構造を用いた多重量子井戸光変調器の断面図である。n-InP半導体基板10上にn-InPクラッド層20、量子井戸構造50、p-InPクラッド層60、p-InGaAsPコンタクト層70を成長後、編約3μmの等波部をエッチングにより形成した後、高級抗InP(Feドープ)80によって埋め込んだ。

上記の構造により、低駆動電圧(2~3V)で 良好な減衰比(15dB以上)の光変顕器が得られた。

本発明による第二の実施例を第2図を参照して 対明する

第一の実施例と異なるのは、本実施例では電子と正孔の有効質量の違いを利用して、伝導帯の基底量子単位が傾斜層に位置し、価電子帯の基底量子単位が急峻な界面に位置するようにしている点である。本実施例では価電子帯の波動関数の電界による移動も第一の実施例のような場合に比べ抑えられるため効果はさらに大きい。

能である。

〔発明の効薬〕

以上述べてきたように、本発明によれば発光および吸収効率の高い高性能な量子弁戸構造光素子を得ることができる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の第一の実施例の説明図であり、第2図は本発明の第二の実施例の説明図である。第3図は本発明の作用の説明図、第4図は従来構造の説明図である。

図中、10はn-InP半導体整板、20はn-InPクラッド層、50は量子井戸構造、51は降壁層、52は井戸層、53はInGaAs磨、54は傾斜層、55は伝導等の基底量子準位、56は価電子帯の基底量子準位、60はp-InPクラッド層、70はp-InGaAsPコンタクト層、150は量子井戸構造、151は除壁層、152は井戸層、153はInGaAs層、154は傾斜層、155は伝導帯の基底量子

第2図に本発明による量子井戸構造 1 5 0 のエネルギーバンド図を示す。降整層 1 5 1 は I n P であり、井戸層 1 5 2 は I n G a A s 壓(犀を4 0 Å) 1 5 3、第1の界面 1 5 7 および第2の界面 1 5 8、 傾斜層 1 5 4 は厚さ 1 5 Åでの組成は 1 . 4 2 μ m 組成 I n G a A s P から 1 . 5 5 μ m 組成 I n G a A s P から 1 . 5 5 μ m 組成 I n G a A s P まで遮続的に変化している。 1 5 5 . 1 5 6 はぞれぞれ井戸層の伝導帯、価電子帯の基度量子準位であり、その禁制帯幅は 0 . 8 5 e V (波長換算で 1 . 4 6 μ m) である。

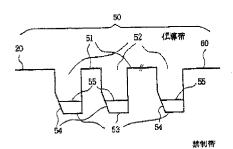
上記の量子井戸橋造を用い第一の実施例と同様な構造の光変調器を作製したところ、低駆動電圧(~2V)で長好な複数比(20dB以上)を有する優れた特性の光変調器が得られた。

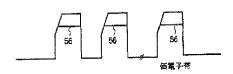
上記実施例ではInP系半導体を用いた量子并 戸構造光素子を例に説明したが、他の半導体、例 えばGaAs/GaAlAs系半導体を用いた場 合でも有効である。また光変調器に限らず半導体 レーザ、発光ダイオード等の発光素子にも応用可

攀位、156は価電子帯の基底量子準位、157 は第1の界面、158は第2の界面である。

代理人 弁理士 内 原 習







20:n - InP タラッド層

50:貴子并戸構造

51:蘇壁屋

52:井戸巖

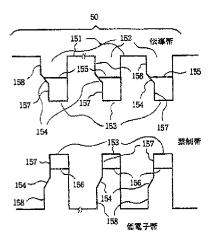
53:InGaAs 屬

54:傾斜器

55: 伝導帯の基底量子準位 56: 価電子幣の基底量子準位

60:p-InPクラッド魔

第2図



150:量子井戸構造

151:締経層

152:井戸曆

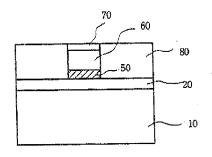
153:InGaAs 層

154:傾斜層 155:伝導帯の基底量子準位

156:領電子帯の基底量子準位 157:第1の界面

158:第2の昇頭

第1図 (b)



10:n-InP半導体基板

20 l n ー InP クラッド層

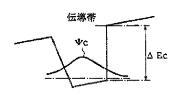
50:量子井戸構造

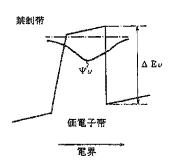
60:p-InPクラッド層

70:pーInGaAsPコンタクト層

80:高抵抗 InP層

第3図





第4図

